Rec'd P TO 18 MAY 2005

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1 1881 - 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1

(43) 国際公開日 2004 年6 月24 日 (24.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/052908 A1

(51) 国際特許分類7:

C07H 19/073, 19/173

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/015529

(22) 国際出願日:

2003年12月4日(04.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-357209 2002年12月9日(09.12.2002)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒105-7117 東京都港区 東新橋一丁目5番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小松 弘典 (KO-MATSU,Hironori) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦

市 長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 檜原 真弓 (HIWARA,Mayumi) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, DE, GB, JP, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

規則4.17に規定する申立て:

USのみのための発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

添付公開書類:

── 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING PHOSPHOROAMIDITE

(54)発明の名称:フォスフォロアミダイトの製造方法

(57) Abstract: A phosphoroamidite product of high purity provided through reduction of the amount of by-product triphosphite impurities formed in conventional processes. Phosphoroamidites are obtained at high purity by suppressing excess reactions with the use of a reaction activator capable of inhibiting the formation of triphosphites. Although it has been difficult to inhibit the formation of triphosphite impurities, the above means enables obtaining phosphoroamidites at high purity.

(57) 要約: 本発明は従来の方法で副成していたトリフォスファイト不純物の量を低減し、高純度のフォスフォロアミダイト製品を提供する。トリフォスファイトを生成しにくい反応活性化剤を使用し、過剰反応を抑えることでフォスフォロアミド類を高純度で得る。本発明により、これまでトリフォスファイト不純物の生成を抑制することが困難であったが、フォスフォロアミド類を高純度で得ることが可能になった。



明細書

フォスフォロアミダイトの製造方法

技術分野

本発明はフォスフォロアミダイトの製造法に関する。さらに詳しくは、本発明は、 一般式〔4〕

(式中、R1は炭素数1から4のアルキル基、シアノ基で置換された炭素数1から4のアルキル基またはシリル基で置換された炭素数1から4のアルキル基を表し、R2は炭素数2から5のアルキル基で置換されたアミノ基または炭素数4から7の脂環状アミノ基を表し、R4は水酸基の保護基を、R5は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1から4のアルキル基または置換された水酸基を、Bは核酸塩基または保護された核酸塩基を表す。)で表されるフォスフォロアミダイト製造の際に、一般式[5]

$$\begin{pmatrix}
R_4O & B \\
O & R_5 \\
O & 2
\end{pmatrix}
P-OR_1$$
(5)

(式中、R1、R4およびR5は前述と同義である。)で表されるトリフォスファイトなる副成物の生成量を減らし、フォスフォロアミダイト生成の選択性を向上するように開発された反応活性化剤に関する。

背景技術

近年、ゲノム創薬の進展に伴い、アンチセンスDNA医薬などが急速に開発されている。それに伴い、原料となるDNAオリゴマー、さらにオリゴマーの原料となるフォスフォロアミダイト類の需要が増大している。フォスフォロアミダイト類を医薬品の用途として用いるためには、非常に高純度の製品を製造する必要がある。

これまでフォスフォロアミダイト類は、たとえばNucleic Acids Res, 12, p4051(1984) [またはNucleic Acids Res, 18, p177(1987)] に記載の方法のように、フォスフォロジアミダイトを反応試剤、テトラゾールを反応活性化剤として用いて、ヌクレオシドの水酸基と反応させる方法で合成できる。この報文では、反応で生成する不純物について詳しく解析している。主要な不純物のうち、水分に起因する分解物については反応系内の水分量を減らすことにより低減できる。しかし、反応で用いた活性化剤の性質によって生成する副成物を低減することは難しい。式1

(式1)

(式中、R1はメチル基またはシアノエチル基を、R2はジイソプロピルアミノ基、R4は4,4'-ジメトキシトリチル基を、Bは1-チミン基を表す。)に示した通り、過剰反応物(一般式〔5 a〕で表されるトリフォスファイト)は、目的とする一般式〔4 a〕で表されるフォスフォロアミダイトがさらに一般式〔3 a〕で表される原料ヌクレオシドと反応することで生成する。混入比率は1%(NMR解析



結果)で少ないとの記述があるが、アンチセンス医薬などの医薬品用途ではさらに 低減する必要がある。フォスフォロアミダイト類は不安定で精製は難しいため、反 応の段階で副成物を極力低減することが必要とされる。US4415732に記載 されているように、テトラゾールは、元来オリゴマーのようなトリフォスファイト の合成を目的として開発されたため、一般式〔4 a〕で表されるフォスフォロアミ ダイトから一般式〔5 a〕で表されるトリフォスファイトに至る反応は非常に速い。 現在でもオリゴマー合成に多用される活性化剤である。

Org. Process Res. Dev. 4, p175 (2000) またはWO9962922に記載の方法は、テトラゾールがコスト高という欠点を改善するため、ピリジンートリフルオロ酢酸塩を用いている。しかしながら、テトラゾールと同様にオリゴマー合成への有用性が記述されているように、トリフォスファイトの生成能は高い。

オリゴマー合成への利用を目的として、テトラゾールに代わる数多くの活性化剤 が報告されている。しかし、オリゴマー合成を固相合成で行うためには、できるだ け短時間でトリフォスファイトを形成する必要がある点でフォスフォロアミダイト の選択的な合成とは目的が異なっていた。つまり、一般式〔4 a〕で表されるフォ スフォロアミダイトを製造するには一般式〔5 a〕で表されるトリフォスファイト の副成量を低減する必要があるため、これらの方法は不向きであった。典型的な例 がTetrahedron Lett. (24) p3171 (1983) に記載さ れている。この報文で報告されている5-(4-ニトロフェニル)テトラゾールは、 テトラゾールの反応速度を大きく上回るように設計されており、非常に効率的にト リフォスファイトであるオリゴマーを生成する。また、フェニルテトラゾールもト リフォスファイト合成の活性化剤として図中に例示されているが、溶解性が悪いこ とから活性評価する価値がないと判断された旨記載があり、フォスフォロアミダイ トを選択的に合成できるという活性化剤としての有用性を見出すには到らなかった。 このように、一般式〔5 a〕で表されるトリフォスファイトへの反応は進行しに くく、一般式〔4 a〕で表されるフォスフォロアミダイトを選択的に合成できるよ うな活性化剤は開発されていなかった。

発明の開示



従来の問題点を鑑み、本発明の課題は効率的で副反応の少ないフォスフォロアミダイト製造法を提供することである。

本発明者らは上記課題について鋭意検討した結果、5-フェニルテトラゾールが 選択性良くフォスフォロアミダイトを生成することを見出し、本発明を完成した。 即ち、本発明は、

[1] 一般式〔1〕

(式中、R1は炭素数1から4のアルキル基、シアノ基で置換された炭素数1から4のアルキル基またはシリル基で置換された炭素数1から4のアルキル基を表し、R2は炭素数2から5のアルキル基で置換されたアミノ基または炭素数4から7の脂環状アミノ基を表す。)で表される化合物を反応剤としてフォスフォロアミダイトを製造する方法であって、一般式[2]

(式中、R3は炭素数1から6の脂環状アルキル基、炭素数1から4のアルキル基で置換されたアリール基または置換されていないアリール基を表す。)で表される置換テトラゾールを反応活性化剤として用いることを特徴とする製造法であり、

[2] 一般式〔3〕

(式中、R4は水酸基の保護基を、R5は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1から4のアルキル基または置換された水酸基を、Bは核酸塩基または保護された核酸塩基を表す。)で表されるヌクレオシド誘導体を原料とし、一般式 [4]

(式中、R1、R2、R4、R5およびBは前述と同義である。)で表されるフォスフォロアミダイトを合成する際に、一般式〔5〕

$$\begin{pmatrix}
R_4O & B \\
O & R_5 \\
O & 2
\end{pmatrix} P - OR_1$$
(5)

(式中、R1、R2、R4およびR5は前述と同義である。)で表されるトリフォスファイトの生成を抑えることを特徴とする[1]に記載の製造法であり、

[3] 一般式 [2] 中、R 3 がフェニル基である [1] 又は [2] に記載の製造法であり、

[4] 一般式〔1〕中、R1がシアノエチル基であり、R2がジイソプロピルアミノ基である[1]から[3]の何れか一項に記載の製造法であり、

[5] 一般式〔3〕および〔4〕中、R4が4, 4'-ジメトキシトリチル基であり、R5が水素原子であり、Bが1-チミン基、N4-ペンゾイル-1-シトシン基、N6-ペンゾイル-9-アデニン基またはN2-イソブチリル-9-グアニン基である〔2〕から〔4〕の何れか一項に記載の製造法である。

本発明により、大量製造可能な方法を用いて、従来の方法に比べ効率的に高純度のフォスフォロアミダイト類を製造することができるようになった。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を詳細に説明する。

一般式〔1〕で表されるフォスフォロジアミダイト等において、R1における炭 素数1から4のアルキル基とは、たとえばメチル基、エチル基、n-プロピル基、 イソプロピル基、シクロプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、イソブチ ル基、 tertープチル基などがあげられる。シアノ基で置換された炭素数1から 4のアルキル基とは、たとえば2-シアノエチル基、2-シアノプロピル基、2-シアノシクロプロピル基、2-シアノブチル基、2-シアノ-2-メチルプロピル 基などがあげられるがこれらに限定されるものではない。R1におけるシリル基で 置換された炭素数1から4のアルキル基とは、たとえば2-トリメチルシリルエチ ル基、2-トリメチルシリルプロピル基、2-トリメチルシリルプチル基、2-ト リメチルシリル-2-メチルプロピル基、2-トリエチルシリルエチル基、2-ト リエチルシリルプロピル基、2-トリエチルシリルブチル基、2-トリエチルシリ ルー2ーメチルプロピル基、2ートリイソプロピルシリルプチル基、2ートリイソ プロピルシリルー2ーメチルプロピル基、2ートリイソプロピルシリルエチル基、 2-トリイソプロピルシリルプロピル基、2-トリイソプロピルシリルブチル基、 2-トリイソプロピルシリル-2-メチルプロピル基、2-イソプロピルプチル基、 2-トリイソプロピルシリル-2-メチルプロピル基、2-(tert-ブチルジ メチルシリル) エチル基、2-(tert-ブチルジメチルシリル) プロピル基、 2- (tert-ブチルジメチルシリル) ブチル基、2- (tert-ブチルジメ チルシリル)-2-メチルプロピル基などがあげられるがこれらに限定されるもの ではない。R2における炭素数2から5のアルキル基で置換されたアミノ基とは、 たとえばジエチルアミノ基、エチル(イソプロピル)アミノ基、ジ(n-プロピ ル)アミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ジシクロプロピルアミノ基、ジ(n-ブ チル)アミノ基、ジ(secープチル)アミノ基、ジ(イソブチル)アミノ基、ジ (tertープチル)アミノ基、ジ(nーペンチル)アミノ基、ジ(イソペンチ ル)アミノ基、ジ(ネオペンチル)アミノ基、ジシクロペンチルアミノ基などがあ えられるがこれらに限定されるものではない。R2における炭素数4から7の脂環 状アミノ基とは、たとえばピロリジノ基、2-メチルピロリジノ基、2、4-ジメ チルピロリジノ基、ピペリジノ基、ヘプタメチレンイミノ基などがあげられるがこ れらに限定されるものではない。

一般式[2]で表される置換テトラゾール等において、R3における炭素数1か ら6の脂環状アルキル基とは、たとえばシクロプロピル基、シクロブチル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基などがあげられる。R3における炭素数1から4 のアルキル基で置換されたアリール基とは、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 イソプロピル基、nープチル基、secープチル基、イソプチル基又はtert-ブチル基で置換されたアリール基を表し、たとえば2-メチルフェニル基、2-エ チルフェニル基、2-イソプロピルフェニル基、2-(2-ブチル)フェニル基、 2- (tert-プチル)フェニル基、3-メチルフェニル基、3-エチルフェニ ル基、3-イソプロピルフェニル基、3-(2-プチル)フェニル基、3-(te rtープチル)フェニル基、4-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、4-(2-ブチル)フェニル基、4-(tert-ブチ (1,1) ル)フェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、2, 6-ジイソプロピルフェニル基、2、6-ビス(2-プチル)フェニル基、2、6 ービス(tertープチル)フェニル基、3-メチルー2-フルフリル基、3-エ チルー2-フルフリル基、3-イソプロピルー2-フルフリル基、3-(2-ブチ チルー2-フルフリル基、4-エチル-2-フルフリル基、4-イソプロピル-2 -フルフリル基、4-(2-プチル)-2-フルフリル基、4-(tert-プチ ル) -2-フルフリル基、3,5-ジメチル-2-フルフリル基などがあげられる がこれらに限定されるものではない。R3における置換されていないアリール基と は、たとえばフェニル基、2-フルフリル基、3-フルフリル基、2-チオフェニ ル基、3-チオフェニル基などがあげられるがこれらに限定されるものではない。 一般式〔2〕で表される置換テトラゾールとしては、特に5-フェニルー1H-テ トラゾールが好ましい。これら置換テトラゾールは、塩基との塩として反応に加え ることもできるし、そのまま加えても良い。塩を形成する塩基としては、有機塩基 が好ましく、たとえばトリエチルアミン、エチルジイソプロピルアミン、トリ(n ープチル)アミン、1-メチルピペリジン、1-メチルピロリジンなどの3級アミ ン類あるいはジエチルアミン、ジイソプロピルアミン、ジ(n-ブチル)アミン、 ピロリジン、ピペリジンなどの2級アミンがあげられるがこれらに限定されるもの ではない。

一般式〔3〕で表されるヌクレオシド誘導体において、R4における水酸基の保 護基とは、メチル基、エチル基、イソプロピル基、n - ブチル基、 i - ブチル基、 tーブチル基、ペンチル基、ベンジル基、2-メトキシベンジル基、3-メトキシ ベンジル基、4-メトキシベンジル基、2-メチルベンジル基、3-メチルベンジ ル基、4-メチルベンジル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、ベンジルオ キシメチル基、ベンジルオキシエチル基、アセトキシメチル基、アセトキシエチル 基、ベンゾイルオキシメチル基、ベンゾイルオキシエチル基、メトキシエトキシエ チル基、プロパルギル基、アリル基等のアルキル基またはアルキル基の先にさらに 置換されたアルキル基、フェニル基、2-メトキシフェニル基、3-メトキシフェ ニル基、4-メトキシフェニル基、4-フェニルフェニル基、2-ピリジニル基、 3-ピリジニル基、4-ピリジニル基等のアリール基、ホルミル基、アセチル基、 プロピオニル基、ベンゾイル基、2-メトキシベンゾイル基、3-メトキシベンゾ イル基、4-メトキシベンゾイル基、2-メチルベンゾイル基、3-メチルベンゾ イル基、4-メチルベンゾイル基、2-ニトロベンゾイル基、3-ニトロベンゾイ ル基、4-ニトロペンゾイル基、4-フェニルベンゾイル基、2-クロロベンゾイ ル基、3-クロロベンゾイル基、4-クロロベンゾイル基などのアシル基、アミノ カルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基、メチルアミノカルボニル基、エチル アミノカルボニル基、ジエチルアミノカルボニル基、フェニルアミノカルボニル基 などのウレタン基、メタンスルホニル基、エタンスルホニル基、ベンゼンスルホニ ル基、2-メチルベンゼンスルホニル基、3-メチルベンゼンスルホニル基、4-メチルベンゼンスルホニル基、トリフルオロメタンスルホニル基、トリクロロメタ ンスルホニル基等のスルホン酸エステル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリ ル基、 t - プチルジメチルシリル基、 t - プチルジフェニルシリル基などのシリル 基、トリチル基、4-メトキシトリチル基、4、4'-ジメトキシトリチル基など のトリチル基があげられる。

R5におけるハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。R5における炭素数 1 から 4 のアルキル基とは、たとえばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、n-プチル基、s e c-プチル基、イソプチル基、 t e r t-プチル基などがあげられる。

R5における置換された水酸基とは、カルボン酸エステル、スルホン酸エステル、 エーテル、ウレタン、シリル基などの一般的な水酸基の保護基となりうる置換基に より置換された水酸基を表す。水酸基の保護基の例としては、たとえばメチル基、 エチル基、イソプロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル基、ペンチ ル基、ペンジル基、2-メトキシペンジル基、3-メトキシペンジル基、4-メト キシベンジル基、2-メチルベンジル基、3-メチルベンジル基、4-メチルベン ジル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、ベンジルオキシメチル基、ベンジ ルオキシエチル基、アセトキシメチル基、アセトキシエチル基、ベンゾイルオキシ メチル基、ベンゾイルオキシエチル基、メトキシエトキシエチル基、プロパルギル 基、アリル基等のアルキル基またはアルキル基の先にさらに置換されたアルキル基、 フェニル基、2-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフ エニル基、4-フェニルフェニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基等のアリール基、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾ イル基、2-メトキシベンゾイル基、3-メトキシベンゾイル基、4-メトキシベ ンゾイル基、2-メチルベンゾイル基、3-メチルベンゾイル基、4-メチルベン ゾイル基、2-ニトロペンゾイル基、3-ニトロペンゾイル基、4-ニトロペンゾ イル基、4-フェニルペンゾイル基、2-クロロベンゾイル基、3-クロロベンゾ イル基、4-クロロベンゾイル基などのアシル基、アミノカルボニル基、ジメチル アミノカルポニル基、メチルアミノカルポニル基、エチルアミノカルポニル基、ジ エチルアミノカルボニル基、フェニルアミノカルボニル基などのウレタン基、メタ ンスルホニル基、エタンスルホニル基、ベンゼンスルホニル基、2-メチルベンゼ ンスルホニル基、3-メチルベンゼンスルホニル基、4-メチルベンゼンスルホニ ル基、トリフルオロメタンスルホニル基、トリクロロメタンスルホニル基等のスル ホン酸エステル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、tープチルジメチ ルシリル基、tープチルジフェニルシリル基などのシリル基が挙げられる。

R 5 の置換された水酸基の例としてはたとえば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、nープチルオキシ基、iープチルオキシ基、tープチルオキシ基 ま、ペンチルオキシ基、ベンジルオキシ基、2ーメトキシベンジルオキシ基、3ーメトキシベンジルオキシ基、4ーメトキシベンジルオキシ基、2ーメチルベンジルオキシ基、メトキシストキシストルベンジルオキシ基、メトキシストルベンジルオキシ基、メトキシストルベンジルオキシ基、メトキシストルベンジルオキシ

エチルオキシ基、エトキシエチルオキシ基、ペンジルオキシメトキシ基、ペンジル オキシエトキシ基、アセトキシメトキシ基、アセトキシエトキシ基、ペンゾイルオ キシメトキシ基、ベンゾイルオキシエトキシ基、メトキシエトキシエトキシ基、プ ロパルギルオキシ基、アリルオキシ基、フェニルオキシ基、2-メトキシフェニル オキシ基、3-メトキシフェニルオキシ基、4-メトキシフェニルオキシ基、4-フェニルフェニルオキシ基、2-ピリジニルオキシ基、3-ピリジニルオキシ基、 4-ピリジニルオキシ基、ホルミルオキシ基、アセチルオキシ基、プロピオニルオ キシ基、ベンゾイルオキシ基、2-メトキシベンゾイルオキシ基、3-メトキシベ ンゾイルオキシ基、4-メトキシベンゾイルオキシ基、2-メチルベンゾイルオキ シ基、3-メチルベンゾイルオキシ基、4-メチルベンゾイルオキシ基、2-ニト ロベンゾイルオキシ基、3-二トロベンゾイルオキシ基、4-二トロベンゾイルオ キシ基、4-フェニルベンゾイルオキシ基、2-クロロベンゾイルオキシ基、3-クロロベンゾイルオキシ基、4-クロロベンゾイルオキシ基、アミノカルボニルオ キシ基、ジメチルアミノカルポニルオキシ基、メチルアミノカルポニルオキシ基、 エチルアミノカルボニルオキシ基、ジエチルアミノカルボニルオキシ基、フェニル アミノカルボニルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基、エタンスルホニルオキシ 基、ベンゼンスルホニルオキシ基、2-メチルベンゼンスルホニルオキシ基、3-メチルペンゼンスルホニルオキシ基、4-メチルベンゼンスルホニルオキシ基、ト リフルオロメタンスルホニルオキシ基、トリクロロメタンスルホニルオキシ基、ト リメチルシリルオキシ基、トリエチルシリルオキシ基、t-ブチルジメチルシリル オキシ基、tープチルジフェニルシリルオキシ基などが挙げられる。

Bにおける核酸塩基とは、天然型あるいは非天然型いずれの核酸塩基でも良く、たとえば1-チミン基、1-シトシン基、9-アデニン基、9-グアニン基、1-ウラシル基、5-トリフルオロ-1-チミン基、5-メチル-1-シトシン基、6-クロロ-9-プリン基、2,6-ジアミノ-9-プリン基、7-アデニン基、7-グアニン基、8-プロモ-9-アデニン基、8-アザー9-アデニン基、8-アザー9-アデニン基、8-アザー9-アデニン基、8-アザー9-グアニン基、8-デアザー9-アデニン基、8-デアザー9-アデニン基、8-デアザー9-アデニン基、8-デアザー9-アデニン基、8-デアザー9-グアニン基などがあげられるがこれらに限定されるものではない。



Bにおける保護された核酸塩基とは、天然型あるいは非天然型いずれの核酸塩基が保護されていても良く、保護基としては通常用いられるものであれば特に限定されない。保護基としては、たとえばアセチル基、イソブチリル基、ベンゾイル基、ジメチルアミノメチリデン基、ジブチルアミノメチリデン基、パルミトイル基、ベンジルオキシアセチル基などがあげられる。保護された核酸塩基としては、たとえばN4ーベンゾイルー1ーシトシン基、N4ーアセチルー1ーシトシン基、N6ーベンゾイルー9ーアデニン基、N2ーイソブチリルー9ーグアニン基などがあげられる。

本発明の方法における反応溶媒としては、反応に影響を与えない限り特に限定されるものではないが、アルコール類以外の非プロトン性溶媒が好ましい。たとえばアセトニトリル、ジクロロメタン、クロロホルム、THF、ジメトキシエタン、酢酸エチル、酢酸プチル、ヘキサン、シクロヘキサン、トルエンなどがあげられる。また、これら溶媒の混合溶媒も使用できる。

本発明の方法における反応温度としては、-30℃から使用する溶媒の沸点までで行うことができる。特に好ましくは-10℃から40℃の間である。

反応剤の使用量としては、後処理に影響を与えない限り特に限定されないが、経済性を考えると、原料のモル量に対して0.8から1.5当量が好ましい。

反応活性化剤の使用量としては、原料のモル量に対して0.01から2当量が好ましく、0.1から1.5当量が特に好ましい。

以下に実施例をあげて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらによって限定されるものではない。

[実施例1]

5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル)チミジン 3'-O-(2-シアノ エチル N. N-ジイソプロピルフォスフォロアミダイト)の合成

5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)チミジン(4-メチル-2-ペンタノンを0.5当量含有する)2.0g、脱水アセトニトリル10mLを混合し、室温で攪拌した懸濁液に、2-シアノエチル N,N,N',N'-テトライソプロピルフォスフォロジアミダイト1.22g(原料のモル数に対して1.2当量)を商下しさらに攪拌する。次いで5-フェニル-1H-テトラゾール0.05g(原料のモル数に対して0.1当量)を添加し、室温で8時間攪拌した。



本反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5 (TEAA250mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果、収率97%であった。表題化合物と一般式[5b]で表される副成物

$$\begin{pmatrix}
R_4O & B \\
O & R_5 \\
O & 2
\end{pmatrix}
P-OR_1$$
(5 b)

(式中、R 1 は 2- シアノエチル基を、R 4 は 4 、4 、- ジメトキシトリチル基を、R 5 は水素原子を、B は 1- チミンを表す。)の比で表される反応選択性(表題化合物のHPLC面積%/副成物のHPLC面積%)は、451 であった。

「比較例1および2]

5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル) - 2'-デオキシチミジン 3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロピルフォスフォロアミダイト) の合成

実施例1と同様の手法で、5-フェニル-1H-テトラゾールの代わりに各々、 テトラゾール0.024g(原料のモル数に対して0.1当量:比較例1)、ピリ ジンートリフルオロ酢酸塩0.068g(原料のモル数に対して0.1当量:比較 例2)を用いて反応を行った。8又は24時間後の反応液を高速液体クロマトグラ フ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5(TEAA250mM)、 検出波長:254nm)にて分析した結果を[表1]に示す。

[表1]

	実施例 1	比較例1	比較例2
反応選択性(8時間後)	4 5 1	265	281
収率(%, 8時間後)	9 4	9 4	6 4
反応選択性(24時間後)	_	_	192
収率(%,24時間後)		_	8 2

上記表1において、反応選択性= (表題化合物のHPLC面積%) / (副成物 [5 b]のHPLC面積%)。 但し、副成物 [5 b]の式中、R1は2-シアノ



エチル基を、R4は4,4'-ジメトキシトリチル基を、R5は水素原子を、Bは1-チミンを表す。

[実施例2]

5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-N6-ベンゾイル-2'-デオキシアデノシン <math>3'-O-(2-シアノエチル N,N-ジイソプロピルフォスフォロアミダイト)の合成

5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル) -N6-ベンゾイル-2'-デオキシアデノシン2.0g、脱水アセトニトリル10mLを混合し、室温で攪拌した懸濁液に、2-シアノエチル N, N, N', N'-テトライソプロピルフォスフォロジアミダイト1.10g(原料のモル数に対して1.2当量)を滴下しさらに攪拌する。次いで5-フェニル-1H-テトラゾール0.53g(原料のモル数に対して1.2当量)を添加し、室温で2時間攪拌した。

本反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5 (TEAA250mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果、収率96%であった。表題化合物と一般式〔5c〕

$$\begin{pmatrix}
R_4O & B \\
O & R_5 \\
O & 2
\end{pmatrix}
P-OR_1$$
(5 c)

(式中、R1は2-シアノエチル基を、R4は4,4'-ジメトキシトリチル基を、R5は水素原子を、BはN6-ベンゾイル-9-アデニンを表す。)で表される副成物の比で表される反応選択性(表題化合物のHPLC面積%/副成物のHPLC面積%)は、152であった。さらに96時間後の反応液を分析した結果、収率99%、反応選択性は187であった。

[実施例3]

5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル)-N6-ベンゾイルー<math>2'-デオキシアデノシン 3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロピルフォスフォロアミダイト)の合成

実施例2と同様の手法で、5-フェニル-1H-テトラゾールの当量を変えて反応を行った。5-フェニル-1H-テトラゾール0.04g(原料のモル数に対して0.1当量)を用いて24時間攪拌した。

本反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5 (TEAA250mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果、収率99%であった。表題化合物と一般式〔5c〕で表される副成物の比で表される反応選択性(表題化合物のHPLC面積%/副成物のHPLC面積%)は、699であった。

[実施例4]

5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル)-N6-ベンゾイル-2'-デオキシアデノシン <math>3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロピルフォスフォロアミダイト)の合成

実施例2と同様の手法で、5-フェニル-1H-テトラゾールの当量を変えて反応を行った。5-フェニル-1H-テトラゾール0.22g(原料のモル数に対して0.5当量)を用いて8時間攪拌した。

本反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5 (TEAA250mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果、99%であった。表題化合物と一般式〔5c〕で表される副成物の比で表される反応選択性(表題化合物のHPLC面積%/副成物のHPLC面積%)は、785であった。

[比較例3~5]

実施例 2 と同様の手法で、5-7ェニル-1 H-テトラゾールの代わりに各々、テトラゾール 0. 2 5 6 g (原料のモル数に対して 1. 2 当量:比較例 3)、ピリジンートリフルオロ酢酸塩 0. 7 0 7 g (原料のモル数に対して 1. 2 当量:比較例 4)、5-(4-ニトロフェニル) -1 H-テトラゾール 0. 6 8 9 g (原料の



モル数に対して1.2当量:比較例5)を用いて反応を行った。96時間後の反応 液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5 (TEAA250mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果を[表2]に 示す。

[表2]

	実施例 2	比較例3	比較例4	比較例 5
反応選択性	187	4 9	9 1	9
収率 (%)	9 9	9 9	9 2	7 9

[比較例6~8]

実施例4と同様の手法で、5-フェニルー1Hーテトラゾールの代わりに各々、テトラゾール0.107g(原料のモル数に対して0.5当量:比較例6)、ピリジンートリフルオロ酢酸塩0.295g(原料のモル数に対して0.5当量:比較例7)、5-(4-ニトロフェニル)-1Hーテトラゾール0.291g(原料のモル数に対して0.5当量:比較例8)を用いて反応を行った。96時間後の反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル5/5(TEAA250mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果を[表3]に示す。

[表3]

	実施例4	比較例 6	比較例7	比較例8
反応選択性	7 8 5	101	3 9	153
収率 (%)	9 9	9 9	9 2	98

上記表3において、反応選択性= (表題化合物のHPLC面積%)/(一般式〔5 c〕で表される副成物のHPLC面積%)

[実施例5]

-5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル)-N4-ベンゾイル-2'-デオキシシチジン 3'-O-(2-シアノエチル N, N-ジイソプロピルフォスフォロアミダイト)の合成

5'-O-(4, 4'-ジメトキシトリチル)-N4-ベンゾイル-2'-デオキシシチジン2.0g、脱水アセトニトリル10mLを混合し、室温で攪拌した懸濁液に、2-シアノエチル N, N, N', N'-テトライソプロピルフォスフォロジアミダイト1.14g(原料のモル数に対して1.2当量)を滴下しさらに攪拌する。次いで5-フェニル-1H-テトラゾール0.185g(原料のモル数に対して0.4当量)を添加し、室温で5時間攪拌した。

本反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル4/6(TEAA62.5mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果、収率99%であった。表題化合物と副成物[5d]

$$\begin{pmatrix}
R_4O & B \\
O & R_5 \\
O & 2
\end{pmatrix}
P-OR_1$$
(5 d)

(式中、R 1 は 2-シアノエチル基を、R 4 は 4 、4 、-ジメトキシトリチル基を、R 5 は水素原子を、B は N 4-ペンゾイルー1-シトシンを表す。)の比で表される反応選択性(表題化合物のHPLC面積%/副成物のHPLC面積%)は、2 8 4 であった。

[比較例9および10]

N4 ーベンゾイルー5' -O ー (4, 4' - ジメトキシトリチル) <math>-2' ーデオキシシチジン 3' -O ー (2 - シアノエチル N , N - ジイソプロピルフォスフォロアミダイト)の合成

実施例5と同様の手法で、5-フェニル-1H-テトラゾールの代わりに各々、テトラゾール0.088g(原料のモル数に対して0.4当量:比較例9)、ピリジンートリフルオロ酢酸塩0.244g(原料のモル数に対して0.4当量:比較例10)を用いて反応を行った。5時間後の反応液を高速液体クロマトグラフ法(逆相カラム、溶離液:水/アセトニトリル4/6(TEAA62.5mM)、検出波長:254nm)にて分析した結果を[表4]に示す。



_	実施例 5	比較例9	比較例10
反応選択性(5時間後)	284	177	1 1 7
収率(%, 5時間後)	9 9	9 7	9 2

反応選択性= (表題化合物のHPLC面積%) / (副成物〔5 d〕のHPLC面積%) / (副成物〔5 d〕のHPLC面積%) / (目し、副成物〔5 d〕の式中、R 1 は 2 - シアノエチル基を、R 4 は 4 , 4 ' - ジメトキシトリチル基を、R 5 は水素原子を、B は N 4 - ペンゾイルー1 - シトシンを表す。



請 求 の 範 囲

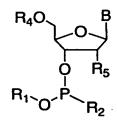
1. 一般式〔1〕

(式中、R1は炭素数1から4のアルキル基、シアノ基で置換された炭素数1から4のアルキル基またはシリル基で置換された炭素数1から4のアルキル基を表し、R2は炭素数2から5のアルキル基で置換されたアミノ基または炭素数4から7の脂環状アミノ基を表す。)で表される化合物を反応剤としてフォスフォロアミダイトを製造する方法であって、一般式〔2〕

(式中、R3は炭素数1から6の脂環状アルキル基、炭素数1から4のアルキル基で置換されたアリール基または置換されていないアリール基を表す。)で表される置換テトラゾールを反応活性化剤として用いることを特徴とする製造法。

2. 一般式〔3〕

(式中、R4は水酸基の保護基を、R5は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1から 4のアルキル基または置換された水酸基を、Bは核酸塩基または保護された核酸塩 基を表す。)で表されるヌクレオシド誘導体を原料とし、一般式 [4]



[4]

(式中、R1、R2、R4、R5およびBは前述と同義である。)で表されるフォスフォロアミダイトを合成することを特徴とする請求項1に記載の製造法。

- 3. 一般式〔2〕中、R3がフェニル基である請求項1又は2に記載の製造法。
- 4. 一般式〔1〕中、R1がシアノエチル基であり、R2がジイソプロピルアミノ基である請求項1から3の何れか一項に記載の製造法。
- 5. 一般式〔3〕および〔4〕中、R4が4、4'ージメトキシトリチル基であり、R5が水素原子であり、Bが1ーチミン基、N4ーベンゾイルー1ーシトシン基、N6ーベンゾイルー9ーアデニン基またはN2ーイソブチリルー9ーグアニン基である請求項2から4の何れか一項に記載の製造法。



International application No.
PCT/JP03/15529

	·				
	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
Int.	C1' C07H19/073, 19/173				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC			
	SEARCHED				
	cumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)			
Int.	C1 ⁷ C07H19/073, 19/173	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included i	in the fields searched		
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	US 5278302 A (UNIVERSITY PATE	•	1-5		
••	11 January, 1994 (11.01.94),	•	- -		
•	& WO 89/11486 A & EP	378615 A			
	& JP 3-501128 A	ţ			
A	JP 63-63694 A (Yuki Gosei Ko	gyo Co., Ltd.).	1-5		
• •	22 March, 1988 (22.03.88),		·- -		
	(Family: none)				
_	TD 60 70001 B (Mines - 5 - 5	, T+d \	1-5		
A	JP 62-70391 A (Nippon Zeon Co 31 March, 1987 (31.03.87),	o., mca.),	1-2		
	(Family: none)	1			
	· '	İ			
		l			
	·	l			
		ì			
		l			
		ł			
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
	Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or				
conside	"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention				
"E" earlier document but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone					
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is					
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such					
means "P" document published prior to the international filing date but later "A" document member of the same patent family than the priority date claimed					
Date of the	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
02 March, 2004 (02.03.04) 23 March, 2004 (23.03.04)					
L_					
Name and n	nailing address of the ISA/	Authorized officer			
Japa	nese Patent Office				
Facsimile N	io.	Telephone No.			